

コンパクトで低価格

膜厚測定・表面形状測定

フィルメトリクス株式会社

膜厚測定システム

世界中で 5000 台以上使用されているベーシックモデルのアカデミック版です。

仕様

- 膜厚測定範囲 15nm ~ 70 μ m
- 測定波長領域 380 - 1050nm
- 測定スポット径 標準 ϕ 1.5mm



F20

FILMETRICS
A KLA Company

商品ラインナップ

- F20-UV
膜厚測定範囲: 1nm-40 μ m
- F20-EXR
膜厚測定範囲: 15nm-250 μ m

オプション

- 透過率測定
- 測定スポット最小 ϕ 0.1 mm
- 12inch 回転ステージ
- コンタクトプローブ

顕微鏡式膜厚測定システム

顕微領域の高精度膜厚測定システムです。最小 2 ミクロンの測定スポット径に対応しています。

仕様

- 膜厚測定範囲 20nm ~ 40 μ m
(5 倍対物レンズ)
- 測定波長領域 400 - 1000nm
- 測定スポット径 ϕ 0.5 μ m - 100 μ m



F40

FILMETRICS
A KLA Company

商品ラインナップ

- F40-UV
膜厚測定範囲: 4 nm - 30 μ m
(15 倍対物レンズ使用時)
- F40-EXR
膜厚測定範囲: 20nm - 70 μ m
(10 倍対物レンズ使用時)

オプション

- 紫外/近赤外対応顕微鏡
- 対物レンズ 5 ~ 100 倍

サンプル測定のご案内

※ 測定膜厚範囲は、膜材料などサンプルの条件によって異なります。

※ 御見積の前に、サンプル測定を実施し、測定の可否、装置仕様のご確認をお願いいたします。

フィルメトリクス株式会社

資料請求等のお問合せ先は

URL : www.filmetrics.co.jp
メール : info@filmetrics.co.jp

3次元表面形状測定システム

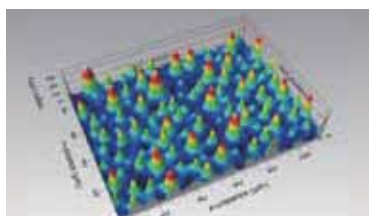
Profilm3D

FILMETRICS
A KLA Company

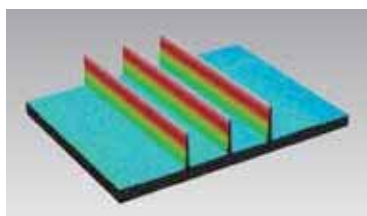
表面形状・段差・粗さ測定システムを身近に！

1台でナノオーダーの表面粗さからミリオーダーの形状段差まで測定できます。

段差測定範囲	～ 10 mm
段差測定正確性	0.7%
XY分解能	最小 0.4μm
測定ステージ	100×100mm 200×200mm



ポリマー混合物の3次元形状



導波路型回折格子



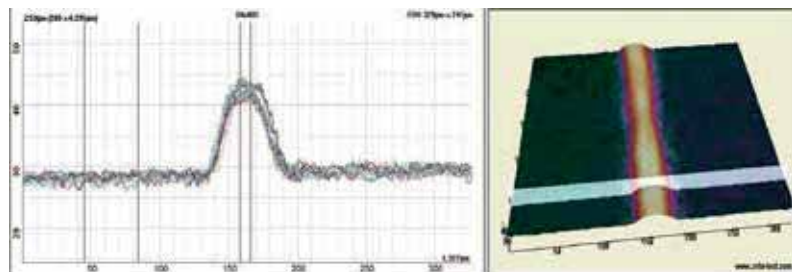
マルチ共焦点顕微鏡システム

Zeta-20

KLA+
INSTRUMENTS

独自の ZDot™ テクノロジーで高速測定！

非接触で段差・粗さ・寸法の測定結果を True Color 画像で表示します。デュアル光源を搭載し、高反射率部と低反射率部を同時に測定できます。



太陽電池サンプル

反射率が95%の銀電極部と、1%以下の黒いセル部を同時に測定



FILMETRICS
A KLA Company

フィルメトリクス株式会社

〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-5-9 新横浜フジカビル8F Tel : 045-473-7109

Email : info@filmetrics.co.jp URL : www.filmetrics.co.jp